×

Original document

# SEMICONDUCTOR MODULE

Patent number:

JP2003309246

Publication date:

2003-10-31

Inventor:

KOMIYAMA MITSURU

Applicant:

OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01L25/065; H01L25/07; H01L25/18

- european:

Application number: JP20030132851 19990426

Priority number(s):

View INPADOC patent family

# Abstract of JP2003309246

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device capable of being used under stacked condition, and a semiconductor module employing the semiconductor device. SOLUTION: The semiconductor module is constituted of a semiconductor chip 101 on which an integrated circuit having a plurality of external terminals 104 on the main surface thereof is formed, a semiconductor layer 110 and a tape 108 having a structure wherein the conductive layer 110 is pinched by insulation layers 109, 113. The main surface of the semiconductor chip 101 is covered by a passivation film 105. The tape 108 is extended from the main surface of the semiconductor chip 101 to the rear surface of the same and is fixed to the semiconductor chip 101 on the main surface side and the rear surface side of the same, respectively. Further, the conductive layer 110 is electrically connected to the plurality of external terminals 104 and is exposed from openings 103a, 103b which are formed on the insulation layers 113 positioned on the main surface and the rear surface of the semiconductor chip 101, respectively.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Also published as:

🔁 ЈР2003309246 (А)

BEST AVAILABLE COPY

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-309246 (P2003-309246A)

(43) 公開日 平成15年10月31日(2003.10.31)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H01L 25/065

25/07 25/18 H01L 25/08

7.

審査請求 有 請求項の数6

OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願2003-132851(P2003-132851)

(62)分割の表示

特願平11-117442の分割

(22)出願日

平成11年4月26日(1999.4.26)

(71)出頭人 000000295

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72)発明者 小宮山 充

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気

工業株式会社内

(74)代理人 100089093

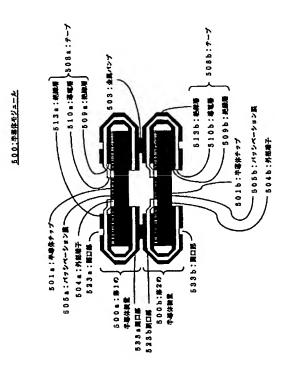
弁理士 大西 健治

# (54)【発明の名称】 半導体モジュール

#### (57)【要約】

【目的】 積み重ねて使用することが可能な半導体装置 および、この半導体装置を用いた半導体モジュールを提 供する。

【構成】 主表面に複数の外部端子104を有する集積回路を形成された半導体チップ101と、導電層110 およびこの導電層110を、絶縁層109、113で挟む構造からなるテープ108とから構成される。また、半導体チップ101の主表面は、パッシベーション膜105で覆われている。テープ108は、半導体チップ101の主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ101の主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ101の主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ101の主表面がよび裏面の夫々に位置する絶縁層113に形成された開口部103aおよび103bから露出されている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に電極が形成された半導体チップ

前記半導体チップの前記表面と前記半導体チップの裏面 とに固着された、絶縁層に挟まれた導電層を有するテー

前記半導体チップの前記表面側の前記絶縁層に設けられ た前記導電層を露出する第1の開口部と、前記半導体チ ップの前記裏面側にの前記絶縁層に設けられた前記導電 層を露出する第2の開口部とを含み、

前記第1の開口部から露出した前記導電層と前記第2の 開口部から露出した前記導電層とが互いに電気的に導通 している前記テープを有する半導体装置を複数互いに積 層し、互いに隣り合う前記半導体装置の前記第1の開口 部と前記第2の開口部をそれぞれ接続して構成される半 遵体モジュール。

【請求項2】 請求項1記載の半導体モジュールにおい て、前記第1の開口部と前記第2の開口部との接続は、 前記第1の開口部および前記第2の開口部内に充填され た金属バンプにより行われることを特徴とする半導体モ 20

【請求項3】 請求項1または2いずれかに記載の半導 体装置において、前記半導体チップの前記表面上に配置 された前記テープの前記絶縁層から前記導電層が突出し ており、前記導電層の前記突出した部分が前記半導体チ ップの前記電極に接続されていることを特徴とする半導 体モジュール。

【請求項4】 請求項3記載の半導体装置において、前 記導電層の前記突出した部分を封止する封止樹脂を含む ことを特徴とする半導体モジュール。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の半導体 装置において、前記テープと前記半導体チップとの間に は級衝膜が設けられていることを特徴とする半導体モジ ュール。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の半導体 装置において、前記半導体チップの側面と前記裏面とが 樹脂で覆われていることを特徴とする半導体モジュー

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】との発明は μ BCA(μ Ball Gri d Array)型半導体装置に関し、特に、積み重ね可能なμ BCA型半導体装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】図13は従来の μ BGA型半導体装置の断 面構造図を示す。図13に示すように、従来のμBGA型 半導体装置1300は、主表面に複数の外部端子130 4を有する集積回路が形成された半導体チップ1301 と、 導電層1310、およびこの導電層1310を絶 録層 1309、および絶縁層 1313で挟む構造からな 50

るテープ1308とから構成される。ここで、例えば導 電層1310はCu、絶縁層1309はポリイミドやガ ラスエポキシ、絶縁層1313はソルダーレジストから 構成される。

【0003】また、半導体チップ1301の主表面は、 バッシベーション膜1305で覆われている。

【0004】さらに、導電層1310は、複数の外部端 子1304と電気的に接続され、かつ、絶縁層1313 に形成された開口部1303aから露出される。

【0005】さらに、テープ1308は、級衝膜130 10 7、例えばエラストマーを介して、パッシベーション膜 1305上に固着されている。

[0006] そして、導電層1310と外部端子130 4との接続部は、樹脂1302で覆われている。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の μBCA型半導体装置は、外部装置、例えば他の半導体装 置と電気的に接続可能な接続部、つまり開口部1303 aから露出する導電層1310が半導体チップ1301 の主表面のみに形成された構造となっているので、複数 の半導体装置を積み重ねて実装することが困難であっ た。

【0008】本発明は、複数の半導体装置の積み重ね実 装を容易にする半導体装置及び半導体モジュールを提供 することを目的とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】そこで本発明の半導体装 置は、 主表面に複数の外部端子を有する集積回路が形 成された半導体チップと、半導体チップの主表面から半 30 導体チップの裏面まで延在し、かつ半導体チップの主表 面側及び裏面側の夫々で半導体チップと固着されるテー プとを有し、テープは、導電層と、この導電層を挟む絶 緑層とからなり、かつ導電層と複数の外部端子とが電気 的に接続され、かつ半導体チップの主表面及び裏面の夫 々に位置する絶縁層に導電層を露出する開口部を夫々に 有することを特徴とする。

【0010】また、本発明の半導体モジュールは、 主 表面に複数の外部端子を有する集積回路が形成された半 導体チップと、半導体チップの主表面から半導体チップ 40 の裏面まで延在し、かつ半導体チップの主表面側及び裏 面側の夫々で半導体チップと固着されるテープとを有 し、テープは、導電層と、この導電層を挟む絶縁層とか らなり、かつ導電層と複数の外部端子とが電気的に接続 され、かつ半導体チップの主表面及び裏面の夫々に位置 する絶縁層に導電層を露出する開口部を有する第1の半 導体装置と、前記開口部で露出する前記導電層表面と電 気的に接続されているパッドを有する第2の半導体装置 とを有することを特徴とする。

#### [0011]

【発明の実施の形態】図1は本発明の第1の実施の形態

の半導体装置について説明するための断面図である。以下、図1を用いて本発明の第1の実施の形態の半導体装置について説明する。

[0012] との半導体装置100は、主表面に複数の外部端子104を有する集積回路を形成された半導体チップ101と、導電層110、およびこの導電層110を絶縁層109、および113で挟む構造からなるテープ108とから構成される。ここで、例えば導電層110はCu、絶縁層109はポリイミドやガラスエポキシ、絶縁層113はソルダーレジストなどから構成され 10 る。

【0013】また、半導体チップ101の主表面は、パッシベーション膜105で覆われている。

【0014】テープ108は、半導体チップ101の主表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ101の主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ101と固着されている。

【0015】さらに、導電層110は、複数の外部端子 104と電気的に接続され、かつ、半導体チップ101 の主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層113に形 20 成された開口部103aおよび103bから露出されている。

【0016】上述した通り、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100では、第1に、半導体装置100の主表面側に開口部103a、裏面側に開口部103bを有するので、開口部103aから露出する導電層110、もしくは、開口部103bから露出する導電層110、もしくは、これら両方と、外部装置、例えば他の半導体装置と電気的に接続できる。つまり、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易にすることができる。第2に、開口部103aから露出する導電層110、もしくは、開口部103aから露出する導電層110、もしくは、開口部103bから露出する導電層110、もしくは、開口部103bから露出する導電層110の一方が他の半導体装置との接続に用いる場合、他方は半導体装置100自身の電気的テストに用いることができる。

【0017】本発明の第1の実施の形態の半導体装置において、開口部103aおよび開口部103bから夫々露出する導電層110は、金属バンブなどを介して、他の半導体装置などと接続することができる。この場合は、絶縁層113にソルダーレジストなどの、溶かした金属に対して濡れ性が低い絶縁層を用いると、金属バン 40プを正確に取りつけることができる。

【0018】さらに、テープ108の代わりに、フレキシブルテーブを用いてもよい。

[0019]図2は本発明の第2の実施の形態の半導体 装置について説明するための断面図である。以下、図2 を用いて本発明の第2の実施の形態の半導体装置につい て説明する。

【0020】との半導体装置200は、本発明の第1の 面および裏面を、樹脂406が天々覆っている。とのた 実施の形態の半導体装置100とほぼ同様の構成のた め、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100の構 め、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の 50 造に比して、半導体チップ101の主表面方向からの外

4

第1の実施の形態の半導体装置100において、テーブ108は、級衝膜207、例えばエラストマーを介在して半導体チップ101と固着することを特徴とする。【0021】本発明の第2の実施の形態の半導体装置200は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のようにテープ108は級衝膜207を介在して半導体チップ101と固着されている。級衝膜207は熱収縮率の差により、テーブ108が半導体チップ101から剥がれるのを防ぐように働く。したがって、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100の構造に比して、よりテープ108と半導体チップ101が、剥がれにくい構造が得られる。

[0022]図3は本発明の第3の実施の形態の半導体 装置について説明するための断面図である。以下、図3 を用いて本発明の第3の実施の形態の半導体装置につい て説明する。

【0023】この半導体装置300は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100において、導電層110と外部端子104との接続部が樹脂302で覆われていることを特徴とする。

【0024】本発明の第3の実施の形態の半導体装置300は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層110と外部端子104との接続部が樹脂302で覆われている。このため、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100の構造に比して、外部30端子104と導電層110が剥がれにくい、堅固な構造を得ることができる。

【0025】図4は本発明の第4の実施の形態の半導体 装置について説明するための断面図である。以下、図4 を用いて本発明の第4の実施の形態の半導体装置につい て説明する。

[0026] この半導体装置400は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100において、導電層110と外部端子104との接続部を樹脂302が寝い、さらには半導体チップ101の側面および裏面を、樹脂406が夫々覆うことを特徴とする。

【0027】本発明の第4の実施の形態の半導体装置400は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層110と外部端子104との接続部を樹脂302が覆い、さらには半導体チップ101の側面および裏面を、樹脂406が夫々覆っている。このため、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100の構造に比して、半導体チップ101の主表面方向からの外

力に対してより強い、堅固な構造を得るととができる。 【0028】図5は本発明の第1の実施の形態の半導体 モジュールについて説明するための断面図である。以 下、図5を用いて本発明の第1の実施の形態の半導体モ ジュールについて説明する。

【0029】との半導体モジュール500は、第1の半導体装置500a、及び第2の半導体装置500bから構成される。ことで、第2の半導体装置500bは、第1の半導体装置500bに、第2の半導体装置500bの説明は、第1の半導体装置500aの説明により省略する。

【0030】との半導体装置500aは、主表面に複数の外部端子504aを有する集積回路を形成された半導体チップ501aと、導電層510a、およびこの導電層510aを絶縁層509a、513aで挟む構造からなるテープ508aとから構成される。ここで、例えば導電層510aはCu、絶縁層509aはポリイミドやガラスエポキシ、絶縁層513aはソルダーレジストから構成される。

【0031】また、半導体チップ501aの主表面は、 パッシベーション膜505aで覆われている。

[0032] テープ508aは、半導体チップ501a の主表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ501 aの主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ501 aと固着されている。

【0033】さらに、導電層510aは、複数の外部端子504aと電気的に接続され、かつ、半導体チップ501aの主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層513aに形成された開口部523aおよび533aから露出されている。

【0034】上述したように本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500は、第1の半導体装置500aの開□部533aから露出する導電層510aが、金属パンプ503を介して、第2の半導体装置500bの開□部523bから露出する導電層510bと接続される。このようにして、第1および第2の半導体装置500a、500bからなる半導体モジュール500が得られる。

[0035] 本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500は、上述のような構造を有するので、テープ 40を有する半導体装置の積み重ね実装を容易に行うことが可能となり、かつ容易に実装できるため、実装工程が簡易なため、コストを下げることも可能となる。

[0036]図6は本発明の第2の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図である。以下、図6を用いて本発明の第2の実施の形態の半導体モジュールについて説明する。

[0037]との半導体モジュール600は、本発明の 第1の実施の形態の半導体モジュール500とほぼ同様 の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第2の 実施の形態の半導体モジュール600の半導体装置600aおよび600bにおいて、テープ608a、およびテープ608bは、夫々般衝膜607aおよび607b、例えばエラストマーを介して、半導体チップ601a、及び半導体チップ601bと固着されていることを特徴とする。

【0038】本発明の第2の実施の形態の半導体モジュール600では、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500と同様の効果を奏するととは言うまでもない。さらに、上記のように緑衝膜607aを有するので、これら級衝膜607a、607bは熱収縮率の差により、半導体チップ601aとテープ608a、半導体チップ601bとテープ608a、半導体チップ601bとテープ608a、半導体チップ601bとテープ608a、半導体チップ601bとテープ608b夫々が剝がれてくい構造が得られる。【0039】図7は本発明の第3の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図である。以

で、図7を用いて本発明の第3の実施の形態の半導体モジュールについて説明する。

【0040】 この半導体モジュール700は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第3の実施の形態の半導体モジュール700の半導体装置700aおよび700bにおいて、導電層710aと外部端子704a、導電層710bと外部端子704bの夫々の接続部が、夫々樹脂702aおよび702bで覆われていることを特徴とする。

1 【0041】本発明の第3の実施の形態の半導体モジュール700は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層710aと外部端子704a、導電層710bと外部端子704bの天々の接続部が、夫々樹脂702aおよび702bで覆われている。このため、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500の構造に比して、導電層710aと外部端子704a、導電層710bと外部端子704bが夫々剥がれにくい、堅固な構造を得ることができる。

[0042]図8は本発明の第4の実施の形態の半導体 モジュールについて説明するための断面図である。以 下、図8を用いて本発明の第4の実施の形態の半導体モ ジュールについて説明する。

【0043】この半導体モジュール800は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第4の実施の形態の半導体モジュール800の半導体装置800aおよび800bにおいて、導電層810aと外部端子804aとの接続部を樹脂802aが覆い、半導体チップ801aの側面および裏面を樹脂806aが覆い、

導電層810bと外部端子804bとの接続部を樹脂802bが覆い、および半導体チップ801bの側面および裏面を樹脂806bが夫々覆うことを特徴とする。

【0044】本発明の第4の実施の形態の半導体モジュール800は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電配810aと外部端子804aとの接続部を樹脂802aが覆い、半導体チップ801aの側面および裏面を樹脂806aが覆い、導電配810bと外部端子804bとの接続部を樹脂80210bが覆い、および半導体チップ801bの側面および裏面を樹脂806bが夫々覆っている。このため、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500の構造に比して、半導体チップ801aおよび801bの主表面方向からの外力に対してより強い、堅固な構造を得ることができる。

【0045】図9は本発明の第5の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図である。以下、図9を用いて本発明の第5の実施の形態の半導体モジュールについて説明する。

【0046】との半導体モジュール900は、半導体装置900aおよびプリント配線基板920から構成される。

【0047】との半導体装置900aは、主表面に複数の外部端子904を有する集積回路を形成された半導体チップ901と、導電層910、およびこの導電層910を絶縁層909、913で挟む構造からなるテープ908とから構成される。ここで、例えば導電層910はCu、絶縁層909はポリイミドやガラスエポキシ、絶縁層913はソルダーレジストから構成される。

【0048】また、半導体チップ901の主表面は、パッシベーション膜905で覆われている。

【0049】テープ908は、半導体チップ901の主表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ901の主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ901と固着されている。

【0050】さらに、導電層910は、複数の外部端子 904と電気的に接続され、かつ、半導体チップ901 の主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層913に形成された開口部903aおよび903bから露出されて 40いる。

【0051】との半導体装置900aの開口部903bで露出する導電層910の表面が、金属バンブ903を用いて、ブリント配線基板920上のバッド921と電気的に接続されている。とこで、バッド921は、例えばNi-Auまたは半田から構成されている。

【0052】上述したように本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール900は、導電層910を露出する関口部903aが半導体チップ901の主表面側に設けられている。したがって、半導体装置900aとプリン 50

ト配線基板920との積み重ね実装を容易にする。さらに、実装に用いられなかった半導体装置の開口部903aから露出する導電層910は、半導体装置900aとプリント配線基板920とが接続されているか否かの電気的テストに用いるととができる。

【0053】図10は本発明の第6の実施の形態の半導体装置モジュールについて説明するための断面図である。以下、図10を用いて本発明の第6の実施の形態の半導体モジュールについて説明する。

[0054] この半導体モジュール1000は、本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール900とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第6の実施の形態の半導体モジュール1000の半導体装置1000aにおいて、テーブ1008が緩衝膜1007、例えばエラストマーを介して、半導体チップ1001と固着されていることを特徴とする。

【0055】本発明の第6の実施の形態の半導体モジュール1000は、本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール900と同様の効果を奏することは言うまでも20 ない。さらに、上記のような級衝膜1007を有するので、この級衝膜1007は熱収縮率の差により、テープ1008が半導体チップ1001から剥がれるのを防ぐように働く。したがって、本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール900の構造に比して、よりテープ1008と半導体チップ1001が剥がれにくい構造が得られる。

[0056]図11は本発明の第7の実施の形態の半導体装置モジュールについて説明するための断面図である。以下、図11を用いて本発明の第7の実施の形態の30半導体モジュールについて説明する。

【0057】この半導体モジュール1100は、本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール900aとほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第7の実施の形態の半導体モジュール1100の半導体装置1100aにおいて、導電配1110と外部端子1104との接続部が樹脂1102で覆われていることを特徴とする。

【0058】本発明の第7の実施の形態の半導体モジュール1100は、本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール900と同様の効果を姿することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層1110と外部端子1104との接続部が樹脂1102で覆われている。このため、本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール900の構造に比して、外部端子1104と導電層1110が剥がれにくい、堅固な構造を得ることができる。【0059】図12は本発明の第8の実施の形態の半導体装置モジュールについて説明するための断面図である。以下、図12を用いて本発明の第8の実施の形態の半導体モジュールについて説明する。

【0060】この半導体モジュール1200は、本発明

の第5の実施の形態の半導体モジュール900とほぼ同 様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第8 の実施の形態の半導体モジュール1200の半導体装置 1200aにおいて、導電層1210と外部端子120 4との接続部を樹脂1202が覆い、さらには半導体チ ップ1201の側面および裏面を、樹脂1206が夫々 覆うことを特徴とする。

【0061】本発明の第8の実施の形態の半導体モジュ ール1200は、本発明の第5の実施の形態の半導体モ ジュール900と同様の効果を奏することは言うまでも 10 ない。さらに、上記のように導電層1210と外部端子 1204との接続部を樹脂1202が覆い、さらには半 導体チップ1201の側面および裏面を、樹脂1206 が夫々覆っている。とのため、本発明の第5の実施の形 態の半導体モジュール900の構造に比して、半導体チ ップ1201の主表面方向からの外力に対してより強 い、堅固な構造を得ることができる。

#### [0062]

【発明の効果】本発明の半導体モジュールは、第1に、 半導体装置の主表面側に開口部、裏面側に開口部を有す 20 るので、開口部から露出する導電層、もしくは、開口部 から露出する導電層、もしくは、これら両方と、外部装 置、例えば他の半導体装置と電気的に接続できる。つま り、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易にすること ができる。第2に、開口部から露出する導電層、もしく は、開口部から露出する導電層の一方が他の半導体装置 との接続に用いる場合、他方は半導体装置自身の電気的 テストに用いることができる。

【0063】また、本発明の半導体モジュールにおい て、第1の半導体装置は、開口部から露出する導電層を 30 103b:開口部 介して、第2の半導体装置または、ブリント配線基板と 接続される。したがって、本発明の半導体モジュール は、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易に行うこと が可能となり、かつ容易に実装できるため、実装工程が 簡易なため、コストを下げることも可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の半導体装置の構造

を断面図で示すものである。

【図2】本発明の第2の実施の形態の半導体装置の構造 を断面図で示すものである。

10

【図3】本発明の第3の実施の形態の半導体装置の構造 を断面図で示すものである。

【図4】本発明の第4の実施の形態の半導体装置の構造 を断面図で示すものである。

【図5】本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図6】本発明の第2の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図7】本発明の第3の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図8】本発明の第4の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図9】本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図10】本発明の第6の実施の形態の半導体モジュー ルの構造を断面図で示すものである。

【図11】本発明の第7の実施の形態の半導体モジュー ルの構造を断面図で示すものである。

【図12】本発明の第8の実施の形態の半導体モジュー ルの構造を断面図で示すものである。

【図13】従来の μ BGA型半導体装置の構造の断面図を 示すものである。

【符号の説明】

100:半導体装置

101:半導体チップ

103a:開口部

104:外部端子

105:パッシベーション膜

108:テープ

109:絶縁層

110:導電層

113: 絶縁層

110:事電器 108:デーブ

109:乾燥場 丿

101:半導体チップ

-- 1 0 4 : 外部組子

-105:パッシペーション裏

## [図2] 【図1】 200:宇導体製量 100:字幕体装置 103 a: 南口部 7 103 a:開口路~ 103b:開口鄉一 103b:開口部 110:海電景 > 108:テープ \$108:7-7 -109:乾禄明 丿 109:熱棒場 101:半春体チップ 105:パッシベーション説 --105:パッシペーション膜 - 104:外部端子 -104:外部電框 【図3】 【図4】 300:字事件装置 400:半導体装置 -302:養助 103 a: 第四部 > /406:稅股 103a:周口部 ~ 103b:開口部 ~ 110:導電層 103b:関口部

【図5】

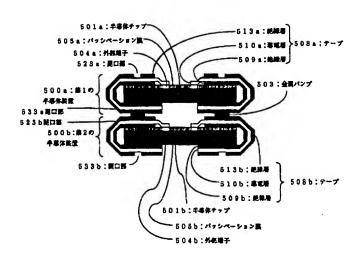
-109:純稗層

101:半導体チップ

一 1 0 4 : 外部電極

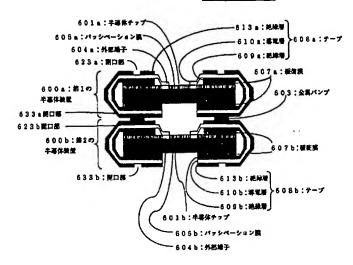
- 105:パッシペーション胰

#### 500:半導体モジュール



【図6】

#### 600:芋専件モジュール

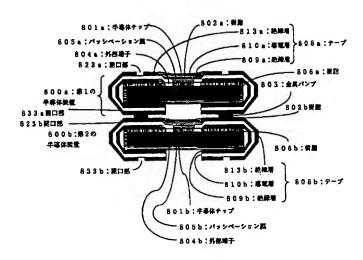


#### 【図7】

#### 700:牛事体モジュール 702a:樹脂 7011:中事件ナップ ---713a:抱趣學 705:パッシペーション裏で - 710 a:事電場 > 708 a:テーブ 704 a:外部椅子。 -709a:乾練湯 723 a:周口部 7 0 3 : 金属パンプ 700m:第1の 平等件收置 733 m 同日部 7236間口部 -700b:第2の 702b:佛殿 中基件数量 7336: 器口無 " 7185: 能服期 7086:9-7 710b:#EE 7016:中華ネチップ 一 7056:パッシペーション賞 \_\_\_\_\_704b:外部第子

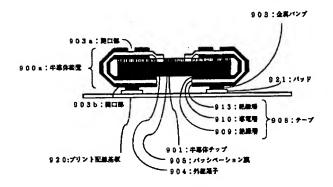
【図8】

# 800:半導体モジュール



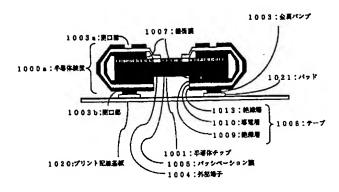
## 【図9】

#### 800:平準体モジュール



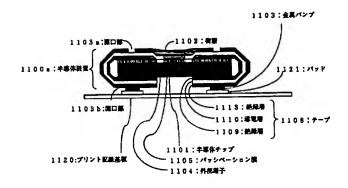
## 【図10】

#### 1000:字母体モジュール



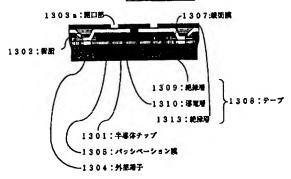
# [図11]

#### 1100: 辛事件モジュール



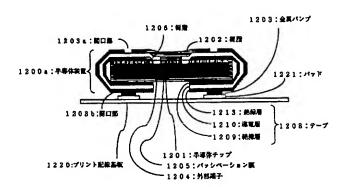
【図13】

#### 1300: 半導件裝置



[図12]

#### 1200: 学事体モジュール



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.